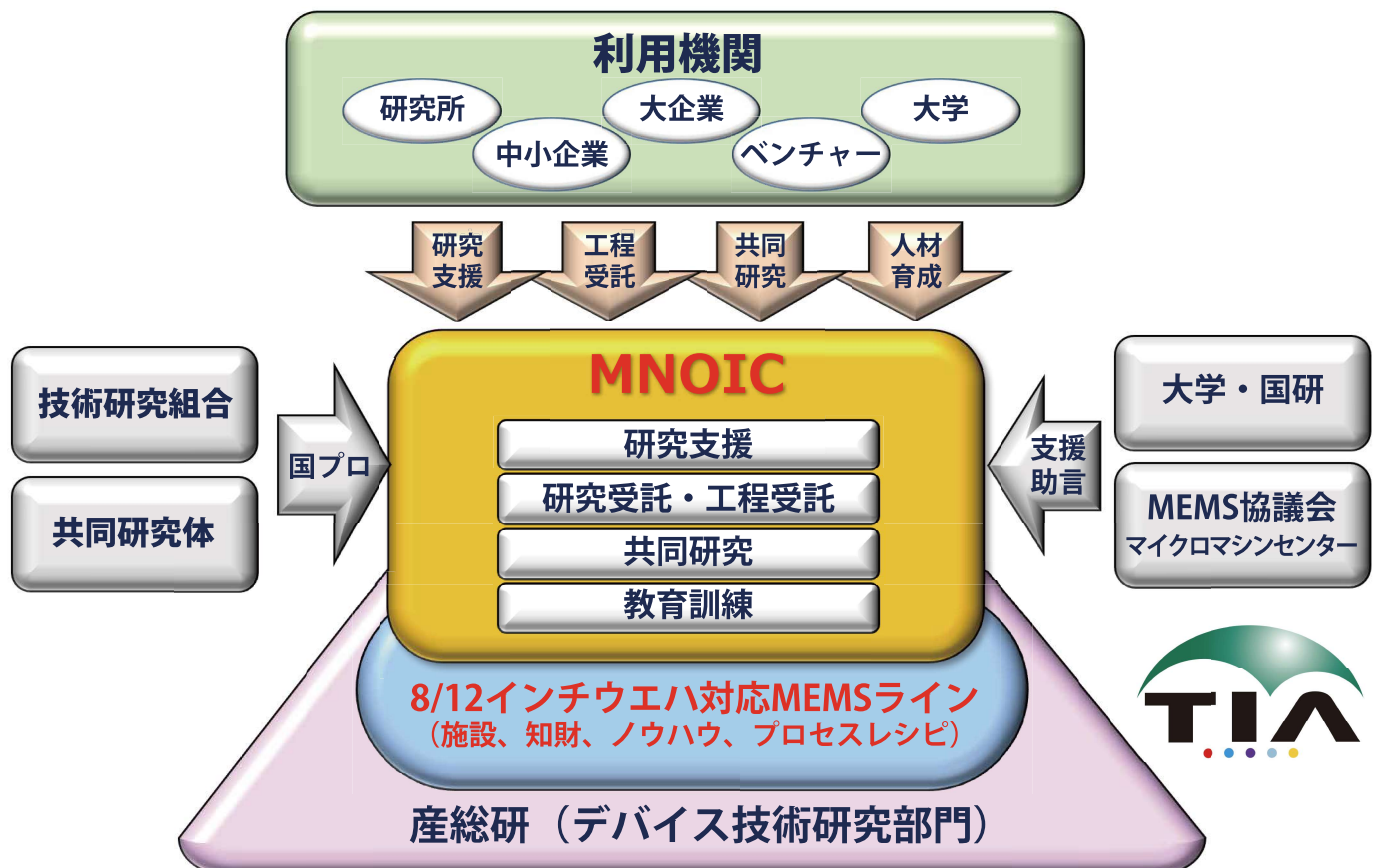


マイクロナノ・オープンイノベーションセンター (MNOIC: エムノイク) では、産業技術総合研究所の共用施設である 8/12インチウエハ対応最先端MEMS製造ラインを活用し、研究開発支援やデバイス作製受託など多様なMEMSファウンドリサービスを提供しています

MNOICが提供するサービス

- ✓ 研究支援コース: ユーザ自主テーマの研究開発の支援
- ✓ 研究受託コース: 最先端設備を用いた研究開発の受託
- ✓ 工程受託コース: 製品化に向けたデバイス作製の受託
- ✓ MEMS研究開発をリードする人材の育成
- ✓ 産官学連携共同研究の提案・推進



MNOICは、MEMS産業活性化を目的とし(一財)マイクロマシンセンターのもとに、2011年4月に設立されました。知の創出から産業化に至るイノベーションを創造するTIAの活動において、MEMS分野でその一翼を担っています。

【お問い合わせ先】

一般財団法人マイクロマシンセンター・MNOIC研究企画部
MONIC開発センター(産総研つくば中央事業所東地区内)
Mail : mnoic@mmc.or.jp

TEL : 03-5835-1870
TEL : 029-886-3471
URL : //mnoic.nanomicro.biz/



利用可能な共用施設 (8/12インチウエハ対応MEMSライン)

洗浄



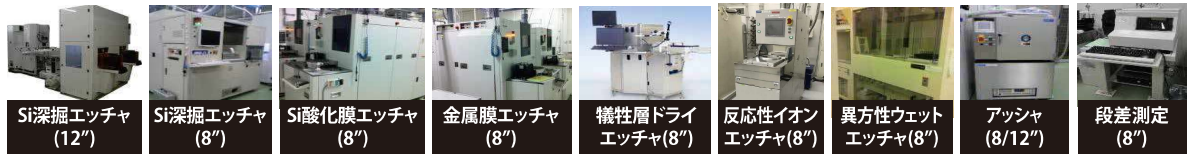
成膜



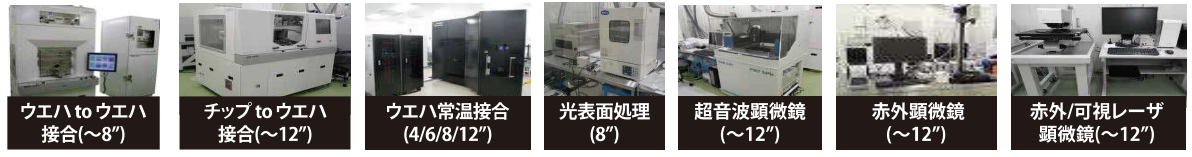
リソグラフィ



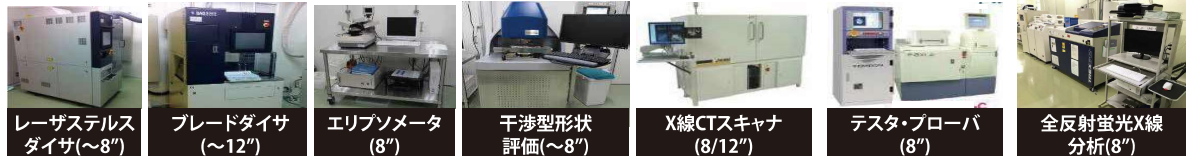
エッチング



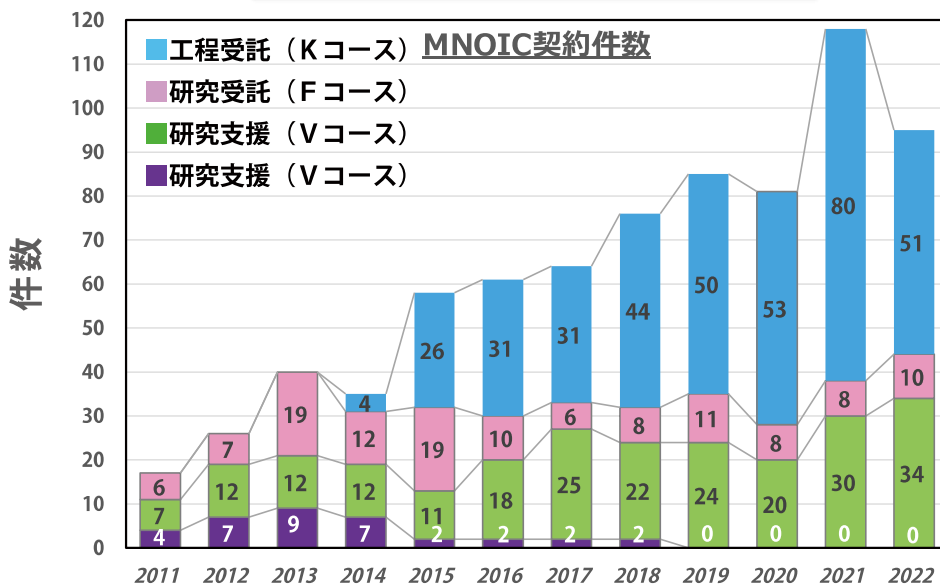
接合加工



加工評価



MNOICの利用実績推移



ベンチャー企業から大企業まで幅広いユーザーに利用され、受託件数の増加とともにMEMS産業の発展に貢献しています

主な工程受託事例

- MEMS高周波デバイス
- MEMS光デバイス
- X線ミラーデバイス
- 大口径ウエハ深溝加工
- 光学部品ウエハ加工
- MEMSセンサ用フォトマスク製作
- パンプ用レジストモールド作製
- MEMS3軸触覚センサ
- AFM用カンチレバー
- 低応力Si窒化膜成膜
- TEOS-Si酸化膜成膜

主な研究受託事例

- 計測機器用部品の試作
- 発電デバイス
- Si金型加工
- 接合テストウエハ製作
- 真空圧力センサ
- 気密検査試験片製作